

Techn. Beschäftigte/r - Entgeltgruppe 11 TV-L Berliner Hochschulen

Fakultät IV - Institut für Hochfrequenz- und Halbleitersystemtechnologien/ Fachgebiet Halbleiterbauelemente

Kennziffer: FO-556 (besetzbar bis 31.12.2014/ Bewerbungsfristende 13.02.2012)

Aufgabengebiet: Betrieb und Weiterentwicklung von Sputteranlagen zur industrie-ähnlichen Herstellung von Front- und Rückkontakten, sowie Vorläuferschichten für a-Si und CIGSe basierte Dünnschichtphotovoltaik am PVcomB; zunächst Aufbau, Betrieb und Instandhaltung der neuen Anlagen, später zusätzlich Mitwirkung bei der Planung, Durchführung und Auswertung von Experimenten zur Schichtoptimierung

Anforderungen: abgeschl. Fachhochschulstudium in Physik, Elektrotechnik, Mikrosystemtechnik, Maschinenbau oder verwandter Fachrichtung oder gleichwertige Fähigkeiten und Erfahrungen; Erfahrung in Betrieb und Wartung von Vakuumbeschichtungsanlagen; Erfahrung in Forschung und Entwicklung an Anlagen und Prozessen zum Magnetronspütern dünner Schichten von Vorteil; Verantwortungsbewusstsein; Selbstständigkeit; Kreativität; Flexibilität; Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit

Ihre **schriftliche** Bewerbung richten Sie bitte unter **Angabe der Kennziffer** mit den üblichen Unterlagen an den Präsidenten der Technischen Universität Berlin, **Fakultät IV, Institut für Hochfrequenz- und Halbleitersystemtechnologien, Fachgebiet Halbleiterbauelemente, Prof. Dr. Boit, Sekr. E 2, Einsteinufer 19, 10587 Berlin.**

Weitere **Informationen zur Stelle** erteilt Ihnen:

E-Mail: silvia.rabe@tu-berlin.de
Tel.: +49 (0)30 314-24403

Diese Stellenanzeige ist erschienen im:

Tagesspiegel vom 22.11.2012